# OKREŚLANIE KONCENTRACJI AZOTU W MONOKRYSZTAŁACH KRZEMU OTRZYMYWANYCH METODĄ CZOCHRALSKIEGO NA PODSTAWIE WIDM ABSORPCYJNYCH W ZAKRESIE DALEKIEJ PODCZERWIENI

Małgorzata Możdżonek<sup>1</sup>, Piotr Zabierowski<sup>1</sup>, Bogdan Majerowski<sup>1</sup>

Monokryształy krzemu otrzymane metodą Czochralskiego (Cz - Si) domieszkowano azotem poprzez wzrost w atmosferze Ar + N<sub>2</sub>. Wykonując pomiary absorpcji optycznej po izotermicznych wygrzewaniach zbadano proces generacji płytkich donorów termicznych (STDs) związanych z kompleksami N<sub>i</sub>-O<sub>mi</sub>. Określono warunki procesów termicznych, w których koncentracja defektów ulega nasyceniu ( $650^{\circ}$ C min. 1godz. lub 600°C min. 3 godz.). Przedstawiono metodę określania koncentracji azotu w monokryształach Cz – Si w zakresie 1 x  $10^{13} \le [N] < 5 x 10^{14}$  at.cm<sup>-3</sup> opartą o pomiar absorpcji w zakresie dalekiej podczerwieni w niskich temperaturach.

## 1. WSTĘP

W obecnie stosowanych technologiach wytwarzania elementów półprzewodnikowych, domieszkowanie azotem monokryształów krzemu wytwarzanych metodą Czochralskiego (Cz – Si) jest bardzo obiecujące. Pozwala ono bowiem zwiększyć stopień precypitacji tlenu powodując wzrost koncentracji wytrąceń tlenowych przy jednoczesnym zmniejszeniu ich rozmiarów [1]. Efekt ten, to wynik dużej koncentracji stabilnych temperaturowo zarodków do precypitacji obecnych w kryształach domieszkowanych azotem. Jest to szczególnie ważne w przypadku podłoży typu p oraz płytek krzemowych o dużych średnicach , gdzie wydajność geterowania jest słaba. Innym efektem domieszkowania kryształów Cz - Si azotem jest kontrola kon-

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, e-mail: e-mail: malgorzata.mozdzonek@itme.edu.pl

centracji i wielkości defektów będących skupiskami wakansów (voids). Powodują one degradację struktur MOS, a w zależności od metody ich ujawnienia oznaczane są jako defekty: COPs (crystal originated pits), FPDs (flow pattern defects), LSTD (laser-scattering tomography defects) [2]. Płytki krzemowe domieszkowane azotem mają również lepsze własności mechaniczne [3, 17].

Azot jest pierwiastkiem lekkim, a jego rozpuszczalność w kryształach krzemu jest o kilka rzędów mniejsza niż tlenu lub węgla i wynosi 4.5 x 10<sup>15</sup> at.cm<sup>-3</sup> [4]. Pomiary koncentracji azotu [N] w kryształach krzemu wykonywane są głównie dwiema metodami: metoda spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS - Secondary Ion Mass Spectroscopy) oraz metodą fourierowskej spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR spectroscopy-Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Metoda SIMS pozwala na określenie całkowitej koncentracji azotu w krysztale krzemu, niezależnie od położenia atomów azotu w sieci krystalicznej i tworzonych przez te atomy kompleksów z defektami rodzimymi lub z atomami innych pierwiastków, a poziom wykrywalności azotu tą metodą wynosi ~1x1014 at/cm3. Metoda spektroskopii FTIR oparta jest o aktywne w podczerwieni mody drgań wiązań, w skład których wchodzą atomy azotu. Linie absorpcyjne świadczące o obecności wiązań N-N i N-O można obserwować w dwóch zakresach spektralnych. W zakresie średniej podczerwieni (MIR) pomiędzy 700 i 1000 cm-1 występują linie absorpcyjne lokalnych modów drgań (LVMs – *localized vibrational modes*) [5-6], a w zakresie dalekiej podczerwieni (FIR) pomiędzy 190 i 290 cm<sup>-1</sup> linie absorpcyjne stanów wzbudzonych kompleksów (N<sub>i</sub>-O<sub>mi</sub>) [7-8].

W kryształach krzemu, azot występuje głównie w postaci pary międzywęzłowej N.-N. Konfiguracja ta jest bardziej stabilna niż pojedynczy atom azotu w pozycji międzywęzłowej lub węzłowej [6-7]. Badania wykazują jej stabilność aż do 1270°C [2]. W widmach absorpcyjnych uzyskanych z pomiarów w 300 K dla kryształów krzemu domieszkowanych azotem otrzymanych metodą topienia strefowego (FZ), występują w zakresie MIR dwie linie absorpcyjne położone przy 963 cm<sup>-1</sup> oraz 766 cm<sup>-1</sup>, pochodzące od lokalnego modu drgającego (LVM) związanego z parą N.-N. [5,11,14]. W przypadku kryształów Cz – Si pary N.-N. oddziałują z atomami tlenu tworząc z nimi kompleksy. Dlatego też, w kryształach Cz - Si intensywności linii 963 cm<sup>-1</sup> i 766 cm<sup>-1</sup> są znacznie mniejsze. Obserwuje się natomiast dodatkowe linie absorpcyjne LVM pochodzące od kompleksów azot-tlen o liczbach falowych: 996 cm<sup>-1</sup> i 1026 cm<sup>-1</sup> (N-N-O) oraz 1018 cm<sup>-1</sup> (N-N-O-O) i 1026 cm<sup>-1</sup> (N najbliższy sąsiad Si-O) [6,15]. Defekty te są nieaktywne elektrycznie. W zakresie FIR występuje szereg linii absorpcyjnych pochodzących od defektów, które wpływają na parametry elektryczne kryształów Si. Dokładna struktura tych kompleksów nie jest jeszcze znana. Najbardziej prawdopodobny model to kompleks (N<sub>i</sub>-O<sub>mi</sub>), jeden międzywęzłowy atom azotu z m międzywęzłowymi atomami tlenu, gdzie m = 1,2,3,4 [8,12]. W niskotemperaturowych (LT - low temperature) pomiarach absorpcyjnych zachowują się one jak płytkie donory termiczne (STDs – Shallow Thermal Donors) [7].

Koncentrację azotu [N] w monokryształach krzemu FZ określa się z pomiarów absorpcyjnych w temperaturze 300 K w oparciu o linię absorpcyjną 963 cm<sup>-1</sup> [9,14]. W monokryształach Cz - Si azot tworzy kompleksy, aby więc określić koncentrację należy uwzględnić jego obecność w różnych wiązaniach. W pomiarach absorpcyjnych wykonywanych w temperaturze pokojowej przy wyznaczaniu [N] uwzględnia się wymienione powyżej linie absorpcyjne z zakresu MIR [10-11]. Poziom wykrywalności tą metodą to [N] > 5 x 10<sup>14</sup> at.cm<sup>-3</sup>. Niższą koncentrację azotu można określić z niskotemperaturowych pomiarów absorpcyjnych (LT-FTIR).

W artykule przedstawione zostaną wyniki prac prowadzonych przez autorów nad otrzymaniem kryształów krzemu metodą Czochralskiego domieszkowanych azotem (NCZ) oraz opracowaniem metody określania koncentracji azotu.

# 2. DOMIESZKOWANIE KRYSZTAŁÓW KRZEMU AZOTEM

Domieszkowanie azotem kryształów Cz - Si można przeprowadzić dwoma sposobami: poprzez wzrost kryształu w atmosferze z domieszką gazowego N<sub>2</sub> lub poprzez włożenie do wsadu azotku krzemu (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>). W naszym przypadku domieszkowanie azotem kryształów Si wykonano według pierwszej metody. Kryształy wzrastały więc w atmosferze Ar + N<sub>2</sub>. Procentowy udział azotu wynosił 6 lub 12% objętości przy ciśnieniu gazów w komorze 17 x 10<sup>2</sup> Pa. Rys. 1 przedstawia zastosowany układ



**Rys. 1.** Schemat układu do domieszkowania kryształów krzemu CZ azotem: 1,3,6 - zawór, 2 - przepływomierz, 4 – reduktor, 5 – filtr, 7 – butla z azotem.

**Fig. 1**. A schematic drawing of the arrangement for nitrogen-doping of the CZ silicon crystals: 1,3,6 – valve, 2 – flow meter, 4 – pressure regulator, 5 – filter, 7 – nitrogen cylinder.

domieszkujący. Badane kryształy posiadały orientację krystalograficzną <100> i były domieszkowane również borem lub fosforem oraz bez dodatkowej domieszki. Parametry otrzymanych kryształów zamieszczone są w Tab. 1.

**Tabela 1.** Zestawienie parametrów otrzymanych kryształów.**Table 1.** Main properties of the grown crystals.

Oznaczenie	Śred- nica [mm]	Orientacja krystal.	Do- miesz- ka	Rezystyw- ność [Ωcm]	Koncent. O <sub>i</sub> [x10 <sup>17</sup> at.cm <sup>-3</sup> ]	Koncent.C <sub>s</sub> [at.cm <sup>-3</sup> ]	Dłu- gość [mm]
NCZ 75	51	<100>	В	7,0 - ,10,0	5,3 - 6,7	<1 x 10 <sup>16</sup>	2070
NCZ 77	76	<100>	Р	2,3 - 7,3	6,1 - 7,3	<1 x 10 <sup>16</sup>	1425
NCZ 83A	76	<100>	ND*	183 - 461	6,3 – 7,3	<1 x 10 <sup>16</sup>	660

\* - kryształ niedomieszkowany

# 3. OKREŚLENIE KONCENTRACJI AZOTU

### 3.1. Przygotowanie próbek

Próbki o wymiarach 20 x 20 x 5 mm wycięte z różnych miejsc wzdłuż kryształów wytrawiono w celu uzyskania powierzchni wypolerowanej, o jakości odpowiedniej do pomiarów optycznych. Pomiary absorpcji w podczerwieni przeprowadzono przy użyciu spektrofotometru fourierowskiego firmy Bruker typ IFS 113v w zakresie widmowym 450-180 cm<sup>-1</sup> ze zdolnością rozdzielczą 0,5 cm<sup>-1</sup>, w temperaturze 12 K. Badane próbki, były zmierzone bezpośrednio po wycięciu oraz po obróbkach termicznych przeprowadzonych w temperaturach 600°C i 650°C w atmosferze N<sub>2</sub>. Czas wygrzewania wynosił od 0,5 do 6,0 godzin. Wg autorów pracy [17] współczynnik dyfuzji azotu w krzemie wynosi 4 x 10<sup>-11</sup> cm<sup>2</sup>s<sup>-1</sup> dla temperatury 750°C. W czasie 6 godz. wygrzewania w temperaturze 650°C azot wnika więc na głębokość ~ 14  $\mu$ m, co nie wprowadza błędu w ocenie koncentracji N. W czasie pomiarów próbki były dodatkowo oświetlone światłem o energii powyżej przerwy zabronionej w celu skompensowania par donor-akceptor. Próbki pochodzące z kryształów Si domieszkowanych borem zmierzone zostały również bez dodatkowego oświetlenia. Tak otrzymane widma absorpcyjne odjęto następnie od widm z podświetleniem. W ten sposób usunięta została linia absorpcyjna 245 cm<sup>-1</sup> pochodząca od boru. Koncentrację tlenu określono z pomiarów absorpcyjnych w temperaturze 300 K wg procedury ASTM F 121-83 stosując współczynnik 2,45 x 1017 cm-2. Pomiary rezystywności wykonane zostały za pomocą sondy czteroostrzowej, zgodnie z normą ASTM F 43-83.

#### 3.2. Wyniki badań i ich analiza

Jak już zostało wspomniane we wstępie, w kryształach Cz – Si:N azot występuje w postaci pary N<sub>i</sub>-N<sub>i</sub> oraz kompleksów N-O. Aby ocenić całkowitą koncentrację [N] należy więc ustalić warunki termodynamicznej równowagi w próbce [8,15]. Można to uzyskać poprzez odpowiednio długie wygrzewanie w określonej temperaturze, aż do wystąpienia nasycenia wiązań N-O, czyli osiągnięcia równowagi pomiędzy atomami azotu i tlenu. Rys. 2 prezentuje widmo absorpcyjne w zakresie FIR uzyskane dla próbki wygrzanej w 600°C przez 3 godz. w czasie którego powstały kompleksy defektowe typu N<sub>i</sub>-O<sub>ni</sub> (STD). W widmie tym występują wszystkie dotychczas wyznaczone linie [8-9], obrazujące stany wzbudzone tych kompleksów. Maksimum intensywności linii obserwowane jest dla temperatury ~650°C [12]. W temperaturach  $> 700^{\circ}$ C kompleksy N<sub>i</sub>-O<sub>ni</sub> ulegają rozpadowi i powstają dimery (N<sub>i</sub> - N<sub>i</sub>) [2]. Gdy koncentracja azotu była  $[N] \ge 10^{14}$  at.cm<sup>-3</sup>, to najintensywniejsze linie absorpcyjne widoczne były już w próbkach mierzonych bezpośrednio po otrzymaniu kryształu, dla koncentracji niższych ujawniały się dopiero po obróbkach termicznych. W niektórych widmach występowały również linie absorpcyjne pochodzące od donorów tlenowych typu NTD (New Thermal Donors). W czasie wygrzewania przez 1 godz. ulegały one anihilacji.



**Rys. 2**. Widmo absorpcyjne kompleksów N-O otrzymane w 12 K. Koncentracja azotu 8,6 x 10<sup>14</sup> at.cm<sup>-3</sup>.

Fig. 2. FIR absorption spectrum due to N-O complexes at 12 K. The nitrogen concentration was  $8,6 \ge 10^{14}$  at.cm<sup>-3</sup>.

W otrzymanych widmach absorpcyjnych największą intensywność mają linie 240,4 cm<sup>-1</sup> i 249,8 cm<sup>-1</sup> odpowiadające przejściom  $1s \rightarrow 2p_{\pm}$ . Wraz ze wzrostem koncentracji azotu intensywności wszystkich linii rosną. Zależność nasycenia danego kompleksu N-O od czasu wygrzewania w temperaturze 650°C zamieszczono na Rys. 3, a dla temperatury 600°C na Rys. 4. Do analizy danych przyjęto intensywność integralną (powierzchnia pod krzywą absorbancji) poszczególnych linii, która została znormalizowana dla próbek o grubości 1 mm. Badane próbki wycięte były z kilku miejsc wzdłuż kryształów i posiadały różną koncentrację azotu oraz tlenu.

Jak widać na Rys. 4, dla temperatury 650°C stan równowagi termodynamicznej dla większości badanych próbek został osiągnięty już po wygrzewaniu przez 1godz. Tylko dla próbki 75DII, wyciętej z końcowej części kryształu wystąpił po 1,5 godz. W przypadku wygrzewania w temperaturze 600°C (Rys. 4) maksimum absorbancji linii 249,8 cm<sup>-1</sup> i 240,4 cm<sup>-1</sup> osiągnięto dopiero po 3 lub 6 godzinach wygrzewania. Otrzymane wyniki pokazują, że czas wygrzewania potrzebny do osiągnięcia stanu równowagi termodynamicznej zależy od koncentracji azotu oraz temperatury wy-



**Rys. 3.** Intensywność integralna linii absorpcyjnych: 249,8 cm<sup>-1</sup> (a) i 240,4 cm<sup>-1</sup> (b), znormalizowana dla próbki o grubości 1 mm, w funkcji czasu wygrzewania w temperaturze 650°C. **Fig. 3.** Integrated absorbance at 249,8 cm<sup>-1</sup> (a) and 240,4 cm<sup>-1</sup> (b) as a function of the annealing time at 650°C. The integrated absorbance is normalized to 1 mm sample thickness.

grzewania. Dla próbek pochodzących z końcowej części kryształów (75DII, 77DII), gdzie koncentracja azotu jest największa, jest on dla obu temperatur najwyższy.



**Rys. 4.** Intensywność integralna linii absorpcyjnych: 249,8 cm<sup>-1</sup> (a) i 240,4 cm<sup>-1</sup> (b) znormalizowana dla próbki o grubości 1 mm, w funkcji czasu wygrzewania w temperaturze 600°C. **Fig. 4.** Integrated absorbance at 249,8 cm<sup>-1</sup> (a) and 240,4 cm<sup>-1</sup> (b) as a function of the annealing time at 600°C. The integrated absorbance is normalized to 1 mm sample thickness.

Na Rys. 5 pokazane są przykładowe widma otrzymane dla temperatur wygrzewania 600°C i 650°C. Widoczne jest, że dla temperatury 600°C intensywność linii 240 cm<sup>-1</sup> jest większa od intensywności linii 249 cm<sup>-1</sup>. Natomiast dla temperatury 650°C sytuacja jest odwrotna. Międzywęzłowe atomy azotu N<sub>i</sub> łączą się z międzywęzłowymi atomami tlenu O<sub>i</sub>, tworząc kompleksy defektowe o składzie N<sub>i</sub>-O<sub>mi</sub>, gdzie m = 1,2,3,4. Obliczenia teoretyczne wykonane w pracy [15] pokazują, że kompleks (N<sub>i</sub>-O<sub>2i</sub>) z jednym atomem azotu i dwoma atomami tlenu znajdującymi się w płaszczyźnie (110) jest najbardziej stabilny. Według H. Alt i współautorów [8] linia 249,8 cm<sup>-1</sup> (N-O-5) pochodzi od kompleksów o składzie  $N_i-O_{2i}$ , natomiast linia 240,4 cm<sup>-1</sup> (N-O-3) od kompleksów  $N_i-O_{3i}$ . Przyjmując te założenia można stwierdzić, że w próbkach pochodzących z kryształu NCZ 75 (Tab. 1) wygrzewanych w temperaturze 650°C więcej jest kompleksów typu  $N_i-O_{2i}$  niż typu  $N_i-O_{3i}$ , podczas gdy w próbkach wygrzewanych w temperaturze 600°C przeważają kompleksy  $N_i$ .  $O_{3i}$ . Może to być właściwością danej obróbki termicznej lub wynikać z poziomu koncentracji tlenu w danym krysztale Si. W tym przypadku koncentracja tlenu w próbkach z temperatury 650°C była trochę niższa (5,3-6,7 x 10<sup>17</sup> at.cm<sup>-3</sup>) od próbek z temperatury 600°C (6-7,3 x 10<sup>17</sup> at.cm<sup>-3</sup>).



**Rys. 5.** Przykładowe widma absorpcyjne otrzymane dla wygrzewań w temperaturze 600°C i 650°C. Próbki różniły się koncentracją azotu.

**Fig. 5.** Typical infrared absorption spectra obtained for samples annealed at 600°C and 650°C. N concentration in samples was different.

Powstające termodonory wpływają oczywiście na parametry elektryczne krzemu. Pomiary rezystywności wykonane na badanych próbkach po kolejnych procesach termicznych pokazują zmianę rezystywności z czasem wygrzewania. W przypadku kryształów typu n (Rys. 6) rezystywność malała wraz ze wzrostem koncentracji termodonorów, a dla typu p rosła. Znaczne zmiany rezystywności widoczne dla niektórych próbek po wygrzewaniu 1 godz., to wynik anihilacji termodonorów tlenowych (NTD), które tworzą się w czasie wzrostu kryształów krzemu CZ.

M. Możdżonek, P. Zabierowski, B. Majerowski



**Rys.7.** Zmiany rezystywności w funkcji czasu wygrzewania w temperaturze 600°C dla kryształów krzemu typu n: a/ NCZ 77, b/ NCZ 83.

**Fig.7.** Resistivity as a function of the annealing time at 600°C for n-type silicon crystals a/ NCZ 77, b/ NCZ 83.

W uzyskanych widmach absorpcyjnych (Rys. 2, 5) intensywności linii 240,4 cm<sup>-1</sup> i 249,8 cm<sup>-1</sup> są znacznie większe niż linii pozostałych. Te dwie linie zostały też użyte do określania koncentracji azotu w kryształach Cz - Si. Z powodu braku możliwości wykonania pomiarów porównawczych metodą SIMS (zbyt niska koncentracja azotu) i przeprowadzenia kalibracji wyników, do obliczeń wykorzystano zależności z prac [12-13]. Wg V.Voronkov'a [12] zależność pomiędzy koncentracją kompleksów  $N_i$ - $O_{mi}$ , czyli koncentracją termodonorów STD ([ $N_s$ ]) a ilością azotu w kryształe krzemu nie jest liniowa lecz  $[N_s]$  jest raczej proporcjonalne do  $[N]^{1/2}$ . Koncentrację STD można wyznaczyć z równania [12]:

$$[N_{..}] \approx (k_{..} + k_{..}) \ge 5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$
 (1)

gdzie: k,, k, -współczynniki absorpcji dla linii 240,4 cm<sup>-1</sup> i 249,8 cm<sup>-1</sup>.

W przypadku, gdy w wyniku odpowiednio długiego wygrzewania osiągnie się maksymalną koncentrację STD, to całkowitą koncentrację azotu opisuje wzór [12]:

$$[N] = [N_{a}] + [N_{a}]^{2}/R$$
(2)

gdzie: *R* - stała zależna od koncentracji tlenu i temperatury wygrzewania.

Dla temperatur 600°C i 650°C wartości *R* wynoszą odpowiednio 5 x 10<sup>14</sup> cm<sup>-3</sup> i 5,7 x 10<sup>13</sup> cm<sup>-3</sup> dla  $[O_i] \approx 7 \times 10^{17}$  at.cm<sup>-3</sup>.

Zależność pomiędzy koncentracją termodonorów a czasem wygrzewania jaką otrzymano dla kryształu krzemu NCZ 77 pokazuje Rys. 7. Widoczne jest, że  $[N_s]$  rośnie z czasem wygrzewania aż do momentu osiągnięcia nasycenia.





**Fig. 7.** Dependence of the shallow thermal donors (STDs) concentration on the annealing time at 600°C.

M. Porrini i współautorzy [13] badali próbki o koncentracji azotu z zakresu 5 x  $10^{12} - 2$  x  $10^{15}$  at.cm<sup>-3</sup> określonej z pomiarów metodą SIMS i wyznaczyli zależność umożliwiającą określenie koncentracji azotu w kryształach Cz - Si z intensywności integralnej, bez konieczności wyznaczania parametru *R*. Zależność ta określona jest równaniem:

$$[N] = (0,309A^2 + 0,083A) \times 10^{16} \text{ (at.cm}^{-3})$$
(3)

gdzie: *A* jest sumą intensywności integralnych linii 240,4 cm<sup>-1</sup> i 249,8 cm<sup>-1</sup>dla próbek o grubości 1 mm.

Koncentrację azotu obliczoną wg powyższego równania w funkcji intensywności integralnej zamieszczono na Rys. 8. Zależność pomiędzy koncentracją azotu określoną wg równania (3), a czasem wygrzewania w danej temperaturze prezentuje Rys. 9. Wyznaczona koncentracja [N] zależy od czasu wygrzewania, co ilustrują uzyskane wyniki. Niższe koncentracje azotu otrzymane dla próbek z kryształu NCZ 75 po wygrzewaniu przez 1,5 godz. w 650°C, odpowiadają występującym zmianom oporności. Może to więc świadczyć o zmianach zachodzących w strukturze kompleksów  $N_i$ - $O_{mi}$  podczas wygrzewania próbek. Pełniejsze wyjaśnienie tego zjawiska wymaga przeprowadzenia badań dla większej ilości próbek. Aby prawidłowo określić koncentrację azotu w kryształach krzemu Cz – Si:N, należy badane próbki poddać odpowiednio długiemu wygrzewaniu, które zapewni powstanie maksymalnej ilości kompleksów  $N_i$ - $O_{mi}$ .



**Rys. 8.** Koncentracja azotu w funkcji intensywności integralnej znormalizowanej dla próbek o grubości 1 mm.

**Fig. 8.** Correlation between the nitrogen concentration and the integrated absorbance. The integrated absorbance is normalized to 1 mm sample thickness.





**Rys. 9.** Zależność koncentracji azotu od czasu wygrzewania w temperaturze: a/ 650°C, b/ 600°C.

Fig. 9. Dependence of the nitrogen concentration on the annealing time at:  $a/650^{\circ}C$ ,  $b/600^{\circ}C$ .

Porównanie wartości koncentracji [N] otrzymanych z obu przedstawionych metod pomiarowych widoczne jest na Rys. 10. Dla [N] < 3 x 10<sup>14</sup> at.cm<sup>-3</sup> korelacja wyników z metod (2) i (3) jest bardzo dobra. W przypadku koncentracji azotu zbliżonej do 9 x 10<sup>14</sup> at.cm<sup>-3</sup> wartość obliczona wg zależności (2) jest znacznie niższa. V. Voronkov wyprowadzając swoją zależność przyjął założenie, że kompleksy mają postać  $N_i$ - $O_{2i}$ . Próbka o koncentracji azotu 8,6 x 10<sup>14</sup> at.cm<sup>-3</sup> została wycięta z końca kryształu Si. Koncentracja tlenu w tej części kryształu była najniższa, co może być powodem, że nie wszystkie atomy azotu tworzą kompleksy  $N_i$ - $O_{mi}$ , lecz część ich prawdopodobnie pozostaje w postaci  $N_{2i}O_m$  lub  $N_{2i}$ . Defekty te widoczne są natomiast tylko w pomiarach wykonywanych w temperaturze 300 K. Tak więc w przypadku dużej koncentracji azotu określenie [N] w oparciu o równanie (2) może być obarczone znacznym błędem.

M. Możdżonek, P. Zabierowski, B. Majerowski



**Rys. 10.** Korelacja wyników koncentracji azotu otrzymanych wg zależności (2) i (3). Linia ciągła pokazuje zależność y = x.

Fig. 10. Correlation between the nitrogen concentration calculated by means of equations (2) and (3). The solid line is y = x.

Jak pokazują wyniki pomiarów badane kryształy Cz- Si:N posiadały koncentrację azotu w zakresie 3 x  $10^{13} - 9 x 10^{14}$  at.cm<sup>-3</sup>. Koncentracja azotu w kryształach nie była stała lecz rosła ze wzrostem odległości od zarodzi (Rys. 11). Wzrost ten jest liniowy i określony głównie przez współczynnik segregacji *K*, który dla azotu wynosi K = 7 x  $10^{-4}$  [4]. Tak niska wartość K sprawia, że w czasie wzrostu kryształów większość azotu pozostaje w cieczy. Rozpuszczalność azotu w roztopionym krzemie wynosi 6 x  $10^{18}$  at.cm<sup>-3</sup>. Przeprowadzone wcześniej badania dla kryształów krzemu FZ domieszkowanych azotem pokazały również, że koncentracja [N] rośnie liniowo ze wzrostem długości kryształu [14].





**Rys. 11.** Koncentracja azotu w funkcji odległości od początku kryształu krzemu NCZ. **Fig. 11.** Variation of the axial nitrogen content in N- doped Si-CZ crystals.

# 4. PODSUMOWANIE

Kryształy krzemu CZ domieszkowane azotem, otrzymano poprzez wzrost kryształów w atmosferze Ar + N<sub>2</sub>. Przeprowadzone badania generacji kompleksów  $N_i$ - $O_{mi}$ będących płytkimi donorami termicznymi (STD) pokazały, że czas wygrzewania potrzebny do osiągnięcia stanu równowagi pomiędzy atomami azotu i tlenu zależy od koncentracji N i temperatury wygrzewania. Maksimum koncentracji poszczególnych kompleksów występuje po wygrzaniu próbek w temperaturze 650°C przez min. 1 godz. lub w temperaturze 600°C przez min. 3 godz. Tworzenie się termodonorów zostało potwierdzone również poprzez pomiar rezystywności badanych próbek. Dla koncentracji azotu [N] < 3 x  $10^{14}$  at.cm<sup>-3</sup> azot tworzy głównie kompleksy  $N_i - O_{mi}$ . W przypadku wyższych koncentracji [N] oraz niskiej koncentracji tlenu, część azotu może pozostawać w postaci kompleksów  $N_{2i}O_m$  lub pary  $N_i \cdot N_i$ , które są obserwowane poprzez pomiary absorpcyjne LT-FTIR. Opracowana została metoda oparta o pomiar absorpcji w niskich temperaturach w zakresie widmowym FIR, umożliwiająca określanie koncentracji azotu w monokryształach Cz – Si:N w zakresie 1 x 10<sup>13</sup> ≤  $[N] < 1 \times 10^{15}$  at.cm<sup>-3</sup>. Stwierdzono, że koncentracja azotu w badanych kryształach Cz - Si:N wynosiła 3 x  $10^{13} - 9 x 10^{14} at.cm^{-3}$ .

### LITERATURA

- Karoui A., Sahtout Karoui F., Rozgonyi G.A., Yang D.: Oxygen precipitation in nitrogen doped Czochralski silicon wafers. I. Formation mechanisms of near and bulk defects. *J. Appl. Phys.*, 96, (2004), 3255-3263
- [2] Voronkov V. V., Flaster R.: The effect of nitrogen on void formation in Czochralski silicon crystals. J. Cryst. Growth, 273, (2005), 412-423
- [3] Vedde J., Gravesen P.: The fracture strength of nitrogen doped silicon wafers. *Mat. Sci. Eng.*, B36, (1996), 246-250
- [4] Yatsurugi Y., Akiyama N., Endo Y., Nozaki T.: Concentration, solubility, and equilibrium distribution coefficient of nitrogen and oxygen in semiconductor silicon. J. Electrochem. Soc.:Solid-State Sci. and Tech., 120, (1973), 975-979
- [5] Wagner P., Oeder R., Zulehner W.: Nitrogen-oxygen complexes in Czochralski-silicon. *Appl. Phys.*, 46, (1988), 73-76
- [6] Jones R., Ewels C., Goss J., Miro J., Deák P., Öberg S., Rasmussen F.B.: Theoretical and isotopic infrared absorption investigation of nitrogen-oxygen defects in silicon. *Semicond. Sci. Technol.*, 9, (1994), 2145-2148
- [7] Shi X. H., Liu P. L., Shi G. L., Shen S. C.: Anealing behavior of N-O complexes in Si grown under nitrogen atmosphere. *Solid State Commun.*, 106, (1998), 667-669
- [8] Alt H. Ch., Gomeniuk Y. V., Bittersberger F., Kempf A., Zemke D.: Far-infrared absorption due to electronic transitons of N-O complexes in Czochralski-grown silicon crystals: influence of nitrogen and oxygen concentration. *Appl. Phys. Lett.*, 87, (2005), 151909-151909
- [9] Itoh Y., Nozaki T., Masui T., Abe T.: Calibration curve for infrared spectrophotometry of nitrogen in silicon. *Appl. Phys. Lett.*, 45, (1985), 488-489
- [10] Matsumoto T., Yamanaka Y., Harada H., Inoue N.: Measurment of infrared absorbance of nitrogen in CZ silicon. *Mat. Sci. Eng.*, B91-92, (2002), 144-147
- [11] Tanahashi K., Yamada-Kaneta H.: Technique for determination of nitrogen concentration in Czochralski silicon by infrared absorption measurement. *Jpn. J. Appl. Phys.*, 42, (2003), L223-L225
- [12] Voronkov V. V., Porrini M., Collareta P., Pretto M. G., Scala R., Flaster R., Voronkova G. I., Batunina A. V., Golovina V. N., Arapkina L. V., Guliaeva A. S.: Shallow thermal donors in nitrogen-doped silicon. *J. Appl. Phys.*, 89, (2001), 4289-4293
- [13] Porrini M., Pretto M. G., Scala R.: Measurement of nitrogen in Czochralski silicon by means of infrared spectroscopy. *Mat. Sci. Eng.*, B102, (2003), 228-232
- [14] Możdżonek M., Zabierowski P., Majerowski B., Miros A., Durska A., Broszkiewicz L., Mirgos W.: Określenie koncentracji azotu w monokryształach krzemu metodą absorpcji w podczerwieni. Praca statutowa ITME, 2005
- [15] Ewels C. P., Jones R., Öberg S., Miro J., Deák P.: Shallow thermal donor defects in silicon. *Phys. Rev. Lett.*, 77, (1996), 865-868

- [16] Von Ammon W., Hölzl R., Virbulis J., Dornberger E., Schmolke R., Gräf D.: The impact of nitrogen on the defect aggregation in silicon. J. Crystal Growth, 226, (2001),19-30
- [17] Murphy J.D., Alpass C.R., Giannattasio A., Senkader S., Falster R.J., Wilshaw P.R.: Nitrogen in silicon: transport and mechanical properties. *Nucl. Inst. and Meth. in Phys. Res.*, B253, (2006), 113-117

# DETERMINATION OF NITROGEN CONCENTRATION IN CZOCHRALSKI SILICON CRYSTALS FROM THE FAR INFRARED ABSORPTION SPECTRA

### SUMMARY

The nitrogen doping of Czochralski silicon crystals was accomplished by adding a small amount of N<sub>2</sub> gas to the argon ambient in the growth chamber. The generation process of shallow thermal donors (STDs) attributed to  $N_i$ - $O_{mi}$  complexes with the measurement of their optical absorption after isothermal annealing was investigated. On the basis of the obtained results, we proposed the annealing conditions when concentration of complexes reaches a saturated value (650°C, min.1 h or 600°C, min. 3 h). We have defined the method for the quantitative measurement of nitrogen in CZ silicon crystals by means of low temperature Fourier transform infrared spectroscopy (LT-FTIR), based on measurement in the far-infrared range. This method can be used for the detection of the nitrogen concentration in the range of 1 x10<sup>13</sup> – 5 x10<sup>14</sup> at.cm<sup>-3</sup>.